

第13回 Cat-CVD 研究会 プログラム・予稿集目次

7月8日(金) : A102 講義室

10:30~10:35 開会の挨拶(武山 真弓(北見工業大学))

10:35~10:40 来賓の挨拶(橘 邦彦(情報技術まちづくり協議会))

招待講演 I 座長: 堀邊 英夫

10:40~11:20 Cat-CVD 技術の現状とこれからの展開

松村 英樹(北陸先端科学技術大学院大学)

一般講演 I

11:20~11:40 ボラザンによりホウ素化したタングステンワイヤからのホウ素原子放出
梅本 宏信、宮田 篤(静岡大学)

11:40~12:00 触媒埋め込みメンブラン上のナノカーボン初期成長過程

爲國 成昭、近藤 英一、渡邊 満洋、大久保 総一郎、日方 威、
中山 明(山梨大学、住友電気工業(株))

12:00~13:20 Coffee Break

一般講演 II 座長: 町田 英明

13:20~13:40 Phosphorous Cat-doping for Improving Performance of Ultra-thin
Thermal-SiO₂/Cat-CVD SiN_x Stacked Passivation

Huynh Thi Cam Tu, Koichi Koyama, Shigeki Terashima, Cong Thanh Nguyen,
Hideki Matsumura(北陸先端科学技術大学院大学)

13:40~14:00 変調アドミタンス法による結晶/非結晶シリコンヘテロ接合の評価
岩崎 真宝、清水 耕作(日本大学)

14:00~14:20 Cat-CVD i-a-Siおよびn-a-Siパッシベーション膜へのITOスパッタ
ダメージとその回復

小西 武雄、大平 圭介(北陸先端科学技術大学院大学)

招待講演 II

14:20~15:00 北見市とソーラーエネルギー活用の取り組み

品田 啓一(北見市商工観光部工業振興課)

15:00~15:20 Coffee Break

一般講演 III 座長: 大平 圭介

15 : 20~15 : 40 低温 SiNx 膜における表面ラジカル処理の効果

武山 真弓、佐藤 勝 (北見工業大学)

15 : 40~16 : 00 リモート型ホットワイヤ装置で生成された原子状水素による Cu 膜の還元
と大気暴露後の昇温脱離ガス分析

田中 康基、熊野 勝文、フロメル ヨーク、平野 栄樹、田中 秀治
(東北大学)

16 : 00~16 : 20 HF-CVD 法によるダイヤモンド膜の形成における SiCN 中間層の検討

片宗 優貴、森 寛人、和泉 亮 (九州工業大学)

招待講演 III 座長: 武山 真弓

16 : 20~17 : 00 カーリングの科学~スポーツ工学としての見地から~

柳 等 (北見工業大学)

17 : 00~18 : 15 ポスターセッション (一般講演)

P-1. Cat-CVD a-Si 膜へのプラズマイオンドーピング

小山 晃一、山口 昇、田中 美和、鈴木 英夫、大平 圭介、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学、株式会社アルバック)

P-2. レジストポリマーの水素原子による分解過程

梅本 宏信、加藤 輝斗、滝口 正侑、高木 誠司、堀邊 英夫 (静岡大学、大阪市大)

P-3. Cat-CVD 法により堆積した窒化 Si 膜の高温アニール後のパッシベーション能力

西川 斉志、大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)

P-4. ラジカル処理によって得られた薄い HfNx 膜のバリア特性

佐藤 勝、武山 真弓 (北見工業大学)

P-5. HW-CVD 法により堆積した SiCN/Si(100)の膜質と密着性の評価

和泉 亮、伊勢田 哲平、藤岡 由有、山田 知宏、門谷 豊 (九州工業大学、福山職業能力開発短期大学校、トップマコート (株))

P-6. 結晶シリコン太陽電池モジュールの電圧誘起劣化現象における基板面方位の影響

山口 世力、増田 淳、大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学、産業技術総合研究所)

P-7. Cat-CVD 法により作製した SiNx/c-Si 構造のフラッシュランプアニールを用いた界面特性の改善

宮浦 純一郎、大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)

P-8. フラッシュランプアニールでの a-Si の結晶化における Cat-CVD で作製した SiN_x 膜の反射防止効果

園田 裕生、大平 圭介 (北陸先端科学技術大学院大学)

18 : 45~20 : 15 意見交換会

7月9日

招待講演 IV 座長: 梅本 宏信

9 : 00~9 : 40 白金ナノ粒子表面で生成した高エネルギー水分子を用いた
金属酸化物薄膜の成長

安井 寛治 (長岡技術科学大学)

一般講演 IV

9 : 40~10 : 00 ホットワイヤ ALD を用いたサファイア上への Co 薄膜合成
中 智明、嶋 紘平、百瀬 健、霜垣 幸浩 (東京大学)

10 : 00~10 : 20 カーボンナノウォールにおける酸素プラズマの効果

伊藤 貴司、山本 大貴、花田 駿亮、野々村 修一 (岐阜大学)

10 : 20~10 : 40 Coffee Break

招待講演 V 座長: 和泉 亮

10 : 40~11 : 20 低温プラズマ CVD-SiN, SiC 成膜技術の開発

筑根 敦弘 (太陽日酸株式会社)

一般講演 V

11 : 20~11 : 40 a-Si への Cat ドーピングのパッシベーション能力への影響

大平 圭介、瀬戸 純一、松村 英樹 (北陸先端科学技術大学院大学)

11 : 40~12 : 00 加熱触媒体法で生成した原子状水素によるポリメタクリル酸メチル
表面への微細構造の形成

西山 聖、高木 誠司、佐藤 絵理子、緒方 寿幸、堀邊 英夫
(大阪市立大学、東京応化工業株式会社)

12 : 00~ 閉会の挨拶

12 : 10~13 : 00 意見交換会